

SEMセミナー

～最新走査電子顕微鏡法の原理とその応用～

日時: **11月30日(水) 10:00～11:30**

場所: 理系複合棟321室

講師: 日本電子株式会社 朝比奈俊輔 氏

【要旨】近年、走査電子顕微鏡法(Scanning Electron Microscopy: SEM)の発展は目覚ましく、電界放出形電子銃(Field Emission: FE)を搭載したFE-SEMは加速電圧1 kVであっても1 nmを切る空間分解能を実現できるようになった。さらに、SEMはエネルギー分散型X線分析(Energy dispersive X-ray spectrometry: EDS)や波長分散型X線分析(Wavelength dispersive X-ray spectrometry: WDS)を搭載することで局所領域の元素同定や定量ができること、電子線後方散乱回折法(Electron backscatter diffraction: EBSD)を搭載することでナノレベルでの結晶情報が得られること、また最近、開発された軟エックス線分光法(Soft X-ray Emission Spectrometry: SXES)により材料の化学結合状態も解析できるようになっている。本発表では、最新SEMの原理と共にさまざまに発展した解析法とその応用を紹介する。

【キーワード】低加速電圧SEM、減速法、低真空法、エネルギー分散型X線分光法(EDS)、軟X線分析法(SXES)

申込み

右のQRコード又は下記サイトからご予約ください。

http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=90

Webによる事前申込は11/29 15時まで。
以降は会場にて参加を受け付けますが、配布資料は事前申込者を優先します。



問い合わせ先

研究基盤センター事務室(理系複合棟307室)

TEL: [895-8967](tel:895-8967) E-mail: irc@lab.u-ryukyu.ac.jp HP: <http://www.irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/>

主催: 研究基盤センター